國立陽明交通大學奈米中心
NationalYangMing
ChiaoTungUnivesity
Nano Facility Center

112.04.12 修訂

新、舊電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)考核記錄表

學校系所:_____姓名:_____ 學號：_____考核日期：_____

特別注意！任一項打勾者不開放其設備權限 □ (舊)PECVD-A □ (新)PECVD-B

壹.是非題:20%答案為 X 者,請圈出錯誤處並更正之

( )1. 目前機台什麼樣的試片都可以進行製程。

_____

( )2. 放置試片進入腔體，哪一種夾子都可以使用，手套不小心碰到也無妨。

_____

( )3. 因為 PECVD 在其他機台旁邊，所以可以圖方便離開製程的機台去忙別的事

_____

( )4. 機台若有異常狀況(非防呆裝置警報)，自行排除即可，不需通知機台管理者。

_____

貳.實作題:80%, 重點:步驟動作及理解程度

1. 使用前機台狀態、水、氣、電等檢查。
2. 操作使用限制說明。
3. 機台操作介面及每個常用頁面的認知與功用。
4. 晶片取放之操作。
5. 機台常用 PROGRAM 中 RECIPE 每個 step 設置的用途(如下方表格)。
6. 機台操作、參數設定。
7. 實驗完成後續作業氣體氣閥開關。
8. 異常狀況之處理。

程式編號	用途說明	程式編號	用途說明
PROGRAM 1		**PROGRAM 37**	
PROGRAM 2		**PROGRAM 38**	
PROGRAM 3		**PROGRAM 39**	
PROGRAM 4(PECVD-B)		**PROGRAM 40**	
PROGRAM 5(PECVD-B)			

PS:1. 考核總分 100 分，成績 80 分以上及格。

2. 通過考核者請持學生證至機台管理者處登錄開卡方得自行操作。

考試時間: ： ～ ： 評分:_____ 考核員簽名:_____